## К расчету изменения работы выхода при адсорбции металлических атомов на полупроводниках

## © С.Ю. Давыдов, А.В. Павлык

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет, 197376 Санкт-Петербург, Россия

(Получена 26 октября 2000 г. Принята к печати 22 ноября 2000 г.)

Для расчета изменения работы выхода  $\Delta \phi$ , вызванного адсорбцией металлических атомов на поверхности полупроводников, предложена простая модель, учитывающая как диполь-дипольное отталкивание адатомов, так и металлизацию адсорбированного слоя при больших покрытиях. Результаты расчета  $\Delta \phi$  при адсорбции щелочных металлов на поверхности (001) кремния хорошо согласуются с данными эксперимента.

Работа выхода является одной из важнейших характеристик адсорбционной системы [1,2]. С теоретической точки зрения наибольший интерес представляет расчет изменения работы выхода  $\Delta \phi$  при увеличении степени покрытия поверхности  $\Theta = N_a/N_{\rm ML}$  адатомами ( $N_a$  — концентрация адсорбированных атомов,  $N_{\rm ML}$  концентрация адатомов в монослое (ML)), позволяющий установить характер взаимодействия атомов в адсорбированном слое [3,4].

По сравнению со случаем адсорбции металлов на металлах [2,5] планомерное исследование адсорбции металлических атомов на полупроводниковых кристаллах началось сравнительно недавно. К настоящему времени достаточно полно изучена адсорбция щелочных металлов (alkali metals — AM) на поверхности (001) кремния (см., например, [6] и ссылки, приведенные там). Исследования [7–15] показали, что структура субмонослойных (0  $\leq \Theta \leq 1$ ) пленок АМ весьма сложна и изменяется с ростом  $\Theta$ . Более того, в системе AM/Si(001), помимо структурных переходов, имеют место и переходы металл-изолятор [14]. Несмотря на это, однако, зависимость  $\Delta \phi(\Theta)$  имеет тот же характер, что и при адсорбции АМ на тугоплавких подложках (ср., например, результаты работ [7,8,10,12,13] с экспериментальными данными, приведенными в [2,5]). Поэтому логично использовать подход, развитый для адсорбции металлов на металлах [16-18], и к полупроводниковым подложкам [19,20].

В настоящей работе предлагается простая модель, пригодная для расчета зависимости  $\Delta\phi(\Theta)$  для системы AM/Si(001), которая игнорирует детали геометрии адсорбированного слоя, а учитывает лишь изменение поверхностной концентрации адатомов, т.е. только плотность адсорбированного слоя. Одновременно мы учтем, что с увеличением  $\Theta$  квазиуровень адатома начинает уширяться в зону как за счет косвенного [21], так и прямого взаимодействия адатомов [22]. Это уширение может быть принято во внимание путем введения за

висящей от степени покрытия  $\Theta$  полуширины квазиуровня  $\Gamma$ :

$$\Gamma(\Theta) = \Gamma_0 (1 + \gamma \Theta), \tag{1}$$

где  $\gamma$  — безразмерный коэффициент. Такой подход к учету размытия квазиуровня в зону уже был опробован нами в работах [23,24].<sup>1</sup>

Рассмотрим атом, на внешней *s*-оболочке которого находится 1 электрон. В результате адсорбции вследствие возможности перехода электрона с адатома на подложку (или с подложки на адатом) число заполнения n становится отличным от 1 и адатом приобретает заряд Z = 1 - n. Зависимость Z от покрытия  $\Theta$  может быть вычислено по формуле [16–18,20]:

$$Z(\Theta) = \frac{2}{\pi} \operatorname{arctg} \frac{\Omega - \xi \Theta^{3/2} Z(\Theta)}{\Gamma(\Theta)}, \qquad (2)$$
$$\xi = 2e^2 \lambda^2 N_{\text{ML}}^{3/2} A.$$

Здесь  $\Omega$  — энергия квазиуровня адатома относительно уровня Ферми подложки;  $\xi$  — константа дипольдипольного отталкивания адатомов;  $2\lambda$  — плечо поверхностного диполя, образованного адсорбированным атомом и его изображением в подложке (диэлектрической поправкой ( $\varepsilon_0 - 1$ )/( $\varepsilon_0 + 1$ ), где  $\varepsilon_0$  — статическая диэлектрическая проницаемость, пренебрегаем);  $A \approx 10$  — безразмерный коэффициент, слабо зависящий от геометрии решетки адатомов.

Изменение работы выхода  $\Delta \phi$  определяется следующим образом [2,16,17]:

$$\Delta \phi(\Theta) = -\Phi \Theta Z,$$
  
$$\Phi = 4\pi e^2 N_{\rm ML} \lambda. \tag{3}$$

Встает вопрос определения параметров модели. Для этого используем экспериментальные данные и начнем

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Приняв бесструктурную модель адсорбированного слоя, мы считаем, что местоположение адатома — величина случайная, и поэтому полагаем уширение квазиуровня пропорциональным первой степени покрытия (см. подробнее [23]).



Зависимости изменения работы выхода от степени покрытия. Сплошными линиями представлены результаты расчета, пунктирными линиями с "крестами" — экспериментальные данные.

с лития [10]. За величину  $\lambda$  примем полусумму ионного  $r_i$  и атомного  $r_a$  радиусов:  $\lambda = (r_i + r_a)/2$ , что отражает дробность заряда адатомов щелочных металлов. Коэффициент A положим равным 10. Будем считать, что покрытие в один монослой составляет 1 ML =  $6.78 \cdot 10^{14}$  см<sup>-2</sup> и достигается за время  $t_{\rm ML} = 10$  мин экспозиции (см. рис. 1 из работы [10]). Предположим также, что между покрытием  $\Theta$  и временем экспозиции t существует прямая пропорциональность. Тогда, взяв из [10] значение  $\Delta \phi(\Theta = 0.1) \approx 1$  эВ (при t = 1 мин), найдем из соотношения (3)  $Z\lambda \approx 0.815$  и, так как  $\lambda = 1.125$  Å (данные по  $r_i$  и  $r_a$  взяты из [25]), получим  $Z_0 \equiv Z(\Theta = 0) \approx 0.72$ . Далее полагаем

$$\Omega = \Omega_0 + \Delta,$$
  
$$\Omega_0 = \phi - I, \quad \Delta = e^2 / 4\lambda. \tag{4}$$

Здесь I — энергия ионизации щелочного атома,  $\phi = 4.85$  эВ — работа выхода на поверхности (001) кремния [25],  $\Delta$  — кулоновский сдвиг квазиуровня адатома. Тогда значение полуширины квазиуровня при нулевых покрытиях  $\Gamma_0$  может быть определено из соотношения

$$\Gamma_0 = \frac{\Omega}{\operatorname{tg}\left(\frac{\pi}{2}Z_0\right)},\tag{5}$$

что для Li дает величину 0.96 эВ.

Для определения коэффициента  $\gamma$  найдем  $Z_{\rm ML} \equiv Z(\Theta = 1)$ , взяв из эксперимента [10] значение  $\Delta \phi_{\rm ML} \approx -2.35$  эВ. Расчет дает  $Z_{\rm ML} \approx 0.17$ . Теперь

из соотношения

$$\gamma = \frac{\Omega - \xi Z_{\rm ML}}{\Gamma_0 \operatorname{tg}\left(\frac{\pi}{2} Z_{\rm ML}\right)} - 1 \tag{6}$$

находим  $\gamma = 3.20$ . Таким образом, мы определили все необходимые параметры для случая Li.

Параметры для Na, K и Cs могут быть найдены аналогичным образом (см. таблицу). Экспериментальные данные по адсорбции Na взяты из работы [9], по К из [26,27]; по Cs — из [19]. Результаты расчетов, сопоставленные с экспериментальными данными, представлены на рисунке. Видно, что для лития и калия согласие хорошее, тогда как для натрия наши расчетные данные заметно ниже результатов работы [9], а для цезия, наоборот, выше, чем данные [19]. В целом, учитывая, что мы использовали крайне упрощенную модель, соответствие теории с опытом следует признать удовлетворительным.

Параметры модели (значения  $\Omega_0, \Delta, \xi, \Phi, \Gamma_0$  даны в эВ)

Параметры	Li	Na	Κ	Cs
$\Omega_0$	-0.49	-0.24	0.56	1.01
$\Delta$	2.57	2.35	1.95	1.61
ξ	5.72	7.07	9.38	11.39
$\Phi$	13.80	17.05	22.64	27.48
$\Gamma_0$	0.96	1.79	3.02	4.07
$Z_0$	0.72	0.59	0.44	0.36
$Z_{\rm ML}$	0.17	0.18	0.13	0.13
$\gamma$	3.02	0.71	1.10	0.43

Проанализируем изменение параметров в ряду есть  $\Omega_0$  объясняется уменьшением  $\Omega_{ML}$  энергии ионизации *I* в этом ряду. Убывание  $\Delta$  и рост  $\xi$  таком и  $\Phi$  связан с увеличением  $r_i$  и  $r_a$  (а следовательно, и  $\lambda$ ) ниче переходе от лития к цезию. Уменьшение заряда  $Z_0$  на м объясняется как ростом энергии квазиуровня  $\Omega$ , так и и увеличением его полуширины  $\Gamma_0$ . Отметим, что если

увеличением его полуширины  $\Gamma_0$ . Отметим, что если заряд  $Z_0$  убывает при переходе от Li к Cs в 2 раза, то заряд  $Z_{\rm ML}$  изменяется лишь на 25%. Связано это с тем обстоятельством, что в отличие от  $\Gamma_0$ , возрастающего в ряду Li  $\rightarrow$  Cs в 4 раза, параметр  $\Gamma_{\rm ML} = \Gamma_0(1 + \gamma)$ , равный 4.05, 3.05, 5.95 и 5.81 эВ для Li, Na, K и Cs соответственно, возрастает менее чем в 1.5 раза, что, совместно с увеличением  $\Omega$ , сглаживает изменения  $Z_{\rm ML}$ .

Для того чтобы понять закономерность изменения параметра  $\gamma$ , значения которого соотносятся друг с другом как 7.62 : 1.69 : 2.33 : 1 в ряду Li–Na–K–Cs, обратимся вновь к работе [23], где показано, что зонное уширение можно описать параметром

$$\eta = \frac{T_{\rm ML}^2 \Gamma_0 \Omega}{(\Omega^2 + \Gamma_0^2)^2},\tag{7}$$

где  $T_{\rm ML}$  — двухцентровый интеграл взаимодействия *s*-орбиталей ближайших щелочных атомов в адсорбированном монослое, который мы принимаем пропорциональным  $d^{-2}$ , где d — расстояние между ближайшими соседями [28]. Расчет параметра  $\eta$  дает для ряда Li–Na– K–Cs следующее соотношение: 8.33 : 6.12 : 2.30 : 1. Таким образом, за исключением Na, получаем вполне удовлетворительное не только качественное, но и количественное соответствие. Причины столь большого расхождения для натрия не ясны.

Отметим, что в рамках стандартной модели адсорбции, основанной на применении гамильтониана Андерсона [29,30], полуширина квазиуровня изолированного адатома  $\Gamma_0 \propto V^2 \rho_S$ , где в нашем случае величина V должна представлять собой матричный элемент взаимодействия *s*-орбитали адатома с *sp*<sup>3</sup>-орбиталью подложки,  $\rho_S$  — плотность состояний субстрата. Ясно, что столь простая трактовка параметра  $\Gamma_0$  здесь не проходит, хотя бы потому, что стандартная для металлических подложек аппроксимация плотности состояний  $\rho_S = \text{const}$ в случае полупроводникового субстрата представляется чрезмерно упрощенной, так как при этом игнорируется щель, зоны поверхностных состояний и т.д. В дальнейшем мы предполагаем использовать предложенную здесь модель для описания других адсорбционных систем металл/полупроводник и, по мере накопления информации о параметре  $\Gamma_0$ , дать ему соответствующую интерпретацию.

Отметим также, что как для нулевого, так и для монослойного покрытий положение квазиуровня адатома или центра зоны, сформированной адатомами, перекрывается с зоной проводимости кремния. Действительно, уровень сродства к электрону для Si равен 3.99 эВ [31], тогда как энергия уровней (отсчитываемая от уровня Ферми) в ряду Li–Na–K–Cs есть соответственно:  $\Omega = 2.08, 2.11, 2.51, 2.62 эВ;$  $\Omega_{\rm ML} \equiv \Omega - \xi Z_{\rm ML} = 1.11, 0.84, 1.29, 1.14 эВ. Вследствие такого перекрытия задача об адсорбции АМ на Si(001) ничем в принципе не отличается от задачи об адсорбции на металле, где также квазиуровень (зона) адатома перекрывается с зоной проводимости субстрата.$ 

Таким образом, в настоящей работе предложена простая модель, позволяющая вполне удовлетворительно описать изменение работы выхода системы, вызванное адсорбцией атомов щелочных металлов на кремнии.

Работа выполнена в рамках федеральной программы "Поверхностные атомные структуры" (грант № 4.5.99).

## Список литературы

- Э.Я. Зандберг, Н.И. Ионов. Поверхностная ионизация (М., Наука, 1969).
- [2] Л.А. Большов, А.П. Напартович, А.Г. Наумовец, А.Г. Федорус. УФН, **122** (1), 125 (1977).
- [3] О.М. Браун. УФЖ. **23** (8), 1234 (1978).
- [4] О.М. Браун, В.К. Медведев. УФН, 157 (4), 631 (1989).
- [5] Physics and Chemistry of Alkali Metal Adsorption, ed. by H.P. Bonzel, A.M. Bradshow, G. Ertl (Amsterdam, Elsevier, 1989).
- [6] С.Ю. Давыдов, ФТТ, **42** (6), 1129 (2000).
- [7] M. Tikhov, G. Boishin, L. Surnev. Surf. Sci., 241 (1), 103 (1991).
- [8] L.S. Johansson, B. Reihl. Phys. Rev. B, 47 (3), 1401 (1993).
- [9] Y.-J. Ko, K.J. Chang, J.-Y. Yi. Phys. Rev. B, 51 (7), 4329 (1995).
- [10] C.Y. Kim, K.S. Shin, K.D. Lee, J.W. Chung. Surf. Sci., 324 (1), 8 (1995).
- [11] K.D. Lee, C.Y. Kim, J.W. Chung. Surf. Sci., 366 (3), L709 (1996).
- [12] Y.-C. Chao, L.S. Johansson, R.I.G. Uhrberg. Phys. Rev. B, 54 (8), 5901 (1996).
- [13] Y.-C. Chao, L.S.O. Johansson, R.I.G. Uhrberg. Phys. Rev. B, 55 (11), 7198 (1997).
- [14] K.D. Lee, J. Chung. Phys. Rev. B, 55 (19), 12 906 (1997).
- [15] H. Hamamatsu, H.W. Yeom, T. Yokoyama, T. Kayama, T. Ohta. Phys. Rev. B, 57 (19), 11 883 (1998).
- [16] J.P. Muscat, D.M. Newns. J. Phys. C, 7 (15), 2630 (1974).
- [17] С.Ю. Давыдов. ФТТ, **19** (11), 3376 (1977).
- [18] С.Ю. Давыдов. ФТТ, **41** (9), 1543 (1999).
- [19] T. Kato, K. Ohtomi, M. Nakayama. Surf. Sci., 209 (1), 131 (1989).
- [20] S.Yu. Davydov. Appl. Surf. Sci., 140 (1), 58 (1999).
- [21] С.Ю. Давыдов. ФММ, 47 (3), 481 (1979).
- [22] С.Ю. Давыдов. ФТТ, **20** (6), 1752 (1978).
- [23] S.Yu. Davydov. Surf. Sci., 407 (1-3), L652 (1998).
- [24] S.Yu. Davydov. Surf. Sci., 411 (1-3), L878 (1998).
- [25] Физические величины. Справочник, под ред. И.С. Григорьева, Е.З. Мейлихова (М., Энергоатомиздат, 1991).
- [26] H. Ishida, K. Terakura. Phys. Rev. B, 40 (17), 11519 (1989).
- [27] K. Kobayashi, Y. Morikawa, K. Terakura, S. Blügel. Phys. Rev. B, 45 (7), 3469 (1992).
- [28] У. Харрисон. Электронная структура и свойства твердых тел (М., Мир, 1983), т. 1.
- [29] Ч. Киттель. Квантовая теория твердых тел (М., Наука, 1967).

- [30] Теория хемосорбции, под ред. Дж. Смита (М., Мир, 1983).
- [31] Ф. Бехштедт, Р. Эндерлейн. *Поверхности и границы* раздела полупроводников (М., Мир, 1990).

Редактор Т.А. Полянская

## On calculations of the work-function change peculiar to adsorption of metallic atoms on semiconductors

S.Yu. Davydov, A.V. Pavlyk

St. Petersburg State Electrotechnical University, 197376 St. Petersburg, Russia